科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 26年 5月 14日現在

| 機関番号: 1 3 9 0 3 |
|---|
| 研究種目: 挑戦的萌芽研究 |
| 研究期間: 2012~2013 |
| 課題番号: 2 4 6 5 5 1 9 1 |
| 研究課題名(和文)スケルトン粒子の構造制御技術の確立とその光学特性評価 |
| 研究課題名(英文)Control of skeletal particle structure and its optical application |
| 研究代表者 |
| 高井 千加(TAKAI, Chika) |
| |
| 名古屋工業大学・工学(系)研究科(研究院)・研究員 |
| |
| 研究者番号:3 0 5 9 9 0 5 6 |
| 交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,100,000円、(間接経費) 930,000円 |

研究成果の概要(和文):スケルトン構造を持つナノシリカ粒子が高い光学特性を発揮することを偶然発見した。スケ ルトン粒子が、ナノサイズであることと、スケルトン構造であることに起因する特性であると考えられるが、現在の光 学特性理論では説明できない。本研究では、スケルトンシリカ粒子の構造、微細構造の違いと、粒子の光学特性に与え る影響について整理し、これをもとにスケルトン粒子の補正光学特性理論を構築することを目的とする。

研究成果の概要(英文):In this study, control of skeletal structures such as size, thickness, density, et c. has been develped. Then the relationship between the structures and optical property is studied.

研究分野:化学

科研費の分科・細目: 材料化学・無機工業材料

キーワード:ナノ粒子 シリカ スケルトン

1. 研究開始当初の背景

近年、図1(b)に示すようなナノ中空粒子 をポリマーと混練した薄膜が、高い透明性、 散乱性を合わせ持つことを偶然発見した。粒 子が可視光波長以下のナノサイズであるこ と、またシェルと内部空気の屈折率差による ものであると考えられる。本研究では、さら なる光学特性の向上と制御を目指し、図1(a) に示すスケルトン構造を有するナノ粒子を 設計した(C. Takai et al., Chem. Lett., 2011)。 粒子径がナノサイズであることに加え、シリ カフレームからなるスケルトン構造が特定 波長を散乱、または吸収し、スケルトン粒子 よりも高い光学特性を発揮すると期待でき る。

透明性、散乱性を具備する異常光学特性は、 レイリー散乱やミー散乱理論では説明でき ない。スケルトン粒子の光学特性発現に寄与 する因子を解明し、新たな光学特性理論を構 築し、これを基盤として粒子構造設計指針を 立てる必要がある。



図 1 (a) スケルトン粒子と(b)中空 粒子の電子顕微鏡写真と模式図

2. 研究の目的

スケルトン構造を持つナノシリカ粒子が 高い透明性、散乱性を合わせ持つ異常光学特 性を発揮することを偶然発見した。スケルト ン粒子が、ナノサイズであることと、スケル トン構造であることに起因する特性である と考えられるが、現在の光学特性理論では説 明できない。本研究では、スケルトンシリカ 粒子の構造、微細構造の違いと、粒子の光学 特性に与える影響について整理し、これをも とにスケルトン粒子の補正光学特性理論を 構築することを目的とする。本研究で得られ た理論を基盤として、光学特性に特化した粒 子設計を試み、上述した光学薄膜へ応用する。

3. 研究の方法

スケルトン粒子の構造制御技術を確立
 スケルトン粒子の光学特性発現に関わる
 因子は、以下の三つに分類できる。

1) スケルトン粒子の構造:中実粒子とスケ ルトン粒子の光学特性の違い

2) スケルトン粒子の微細構造:粒子径、シ リカフレーム厚、フレーム微細構造の違い 上記の因子が光学特性に与える影響につい て調べ、構造因子と光学特性の関連性を整理 し、異常光学理論の構築のための基盤とする。

4. 研究成果

1. 構造を制御したスケルトン粒子の合成技 術の確立

スケルトン粒子の光学特性発現に関わる 構造因子を解明するために、異なる構造を有 するスケルトン粒子の合成技術を確立する。

図1に示すように、表面を有機酸で被覆した立方体形状の炭酸カルシウム(CaCO3)をテンプレートとする。テトラエトキシシラン(TEOS)の加水分解により生じたケイ酸(SiOH)が有機酸と交換吸着することにより、CaCO3表面にシリカ層が形成する。このとき、図1(a)に示すように、反応溶媒に有機酸に対して貧溶媒を用いると、シリカフレームからなるスケルトン構造が形成する。一方、図1(b)に示すように、有機酸に対して良溶媒中で反応させると中空粒子となる。



図 1 (a) スケルトン粒子と(b) 中空粒子の 合成機構

有機酸としてデヒドロアビエチン酸(DAA) を用いた。DAA の酸性度はSiOH より高いこと がわかっており、そのため DAA と SiOH の交 換吸着が可能となる。交換吸着は CaCO3 の角、 辺、面の順に起こる。反応溶媒として DAA の 貧溶媒であり極性の高いエタノール(EtOH) を選択すると、脱着した DAA の溶解性が低い ため DAA と SiOH の交換吸着が進行しにくく、 角、辺のみで起こる。従って図1(a)に示すよ うなシリカフレームが形成する。一方、DAA の良溶媒であり極性の低いジグライム(Dg) を選択すると、脱着した DAA がよく溶解する ため、DAA と SiOH の交換吸着が進行し CaCO3 全体で SiOH が被覆し中空粒子が生成する。

さらに、図2に示すように、(a) Et OH~ (b) Et OH/Dg 混合溶媒~(c) Dg 中で合成した粒 子の形状を比較すると、極性の高い Et OH か ら極性が低い Dg になるにつれて、スケルト ン構造の開口径が徐々に小さくなり、中空構 造へ近づくことが推測される。実際に合成し た粒子の SEM 画像を図3に示す。



図 2 (a)EtOH~(b)EtOH/Dg 混合溶媒 ~(c)Dg 中で合成した粒子の形状



図 3 異なる極性溶媒甲で合成した粒子の SEM 写真(溶媒極性は(a) 24.55, (b) 20.76, (c) 16.78, (d) 12.30, (e) 7.30)

光学特性に影響を与えると考えられるス ケルトン粒子の構造として、研究計画2に挙 げた。

2-1)に挙げた中実、中空、スケルトン構造 は、上述した通り作り分けが可能である。

2-2)に挙げた粒子径は、コアである CaCO3 の粒子径を制御することにより、スケルトン 粒子の大きさを制御可能と考える。立方体状 CaCO3 を 30~200nm 程度に制御し、表面を有 機酸被覆することは可能である。しかし、粒 子径が小さくなると立方体の角、辺と面の不 飽和結合数に起因する表面エネルギー差が 小さくなることから、スケルトン構造になり にくいことが考えられるため、スケルトン構 造の形成が可能な径についても明らかにし ておく必要がある。図4に、異なる粒子径を 持つ CaCO3 テンプレートから合成した粒子の SEM 写真を示す。



図 4 異なる粒子径を持つ CaCO3 から合成し た粒子の SEM 写真((a) 80 nm, (b) 50 nm, (c)30 nm)

同じく 2-2)に挙げたフレーム厚は、

TEOS/CaCO3 の割合により変化させることが 可能である。TEOS/CaCO3 を増加させればフレ ーム厚が増加する。DAA と交換吸着した SiOH は、交換吸着時は CaCO3 表面に吸着するが、 それ以降は SiOH 同士の結合になる。ある厚 みの SiOH(縮合して SiO2)が形成すると、そ れ以上 SiOH が吸着するより立方体の面方向 への吸着が優先されると考えられる。したが って、スケルトン構造のフレーム厚の制御が 可能な範囲を把握しておく必要がある。

Iler (The Chemistry of Silica, Wiley Interscience, New York, 1979)がTEOSのゾル ゲル反応機構について述べているように、反 応系のpHや反応時間によってTEOSの加水分 解、SiOHの縮合反応を制御できる。これを応 用して中空粒子のシェル微細構造を制御す る手法を確立している(藤ら、特開 2010-215490)。この手法は2-2)の最後に挙げ たスケルトン構造のフレーム微細構造制御 にも応用可能と考える。反応系のpH や反応 時間と、フレームのみかけ密度との関係を明 らかにし、フレーム微細構造制御技術を確立 することを試みた。

図5に、エタノール中で反応時間を変化させて合成したサンプルのSEM写真を示す。反応時間30分後では、シリカの生成は見られるが酸処理後に崩壊し粒子構造を保持できていない。反応時間60分以降は、スケルトン構造の生成が確認できた。収率は、TEOS比で60分25.9%、90分62.51%、120分69.07%、240分81.99%と、反応時間の増加とともに増加する傾向にあった。観察視野内で、得られた粒子はすべてスケルトン構造であった。



図 5 エタノール中、異なる反応時間で合成 したサンプルの SEM 写真(30 分、60 分、90 分、120 分、240 分)

反応系 pH および TEOS 量について:図5、図 6 に、ジグライムおよびエタノールを反応溶 媒と、アンモニア添加量、TEOS 添加量を変化 させたときに生成したサンプルの SEM 像を示 す。図5より、反応溶媒がジグライムでも、 TEOS 量が少ない条件ではシリカフレームが 生成する。これは、シリカ微粒子の付着が、 図2で示したように CaCO3 の表面エネルギー が高い角や辺から始まっていることを示す。 しかし、反応系中での TEOS 量が少ないと、 ゾルゲル反応速度の進行が遅く、また TEOS のシリカへの転化量も低いため、生産には向 かない。図6より、アンモニア量が少なく、



図 6 反応溶媒ジグライム中で、アンモニア 量、TEOS 量を変化させた際に生成したサンプ ルの SEM 像



図7 エタノール中でアンモニア量、TEOS 量 を変化させた際に生成したサンプルの SEM 像

TEOS 量が多い条件(SD-200)では、アンモ ニア量が多い条件(SD-190)と比較して、中空 構造に近い粒子が得られた。これは、触媒量 が少ないために、生成したシリカ微粒子が、 比較的 CaCO3 表面に均等に不着したためであると考えられる。アンモニア量が十分に存在する条件では、TEOS 量の増減により、シリカフレーム厚を増加または減少させることが可能であるとわかった。

反応溶媒の極性の違いによる粒子構造の 違いについては図3に述べたが、混合溶媒で はなく、単体で極性の異なる溶媒を用いて合 成した結果を図8に示す。用いた溶媒はアル コール系としてメタノール、エタノール、1-プロパノール、1-ブタノールで、この順に極 性が低くなる。ケトン系溶媒としてアセトン、 メチルエチルケトン(MEK)、エーテル系とし てジオキサン(DOX)、エチレングリコール (EG)を用いた。この中で、DOX は生成物が得 られたが、EG 中では生成物が得られなかった ため、EG 以外の溶媒で得られたサンプルの SEM 画像を示した。MeOH 中では、中空粒子が 得られ、EtOH、1-PrOH、1-BtOH、MEK、DOX 中 ではスケルトン構造が得られた。Acetone 中 では、おそらくスケルトン構造が酸処理で崩 壊したと考えられる。これは、Acetone 中で ゾルゲル反応が進みにくいためである。 1-PrOH 中で得られたスケルトン粒子が最も シリカフレームが明瞭に観察され、均質な構 造であることがわかる。



図 8 異なる溶媒中で合成したサンプルの SEM 写真(左上から MeOH、EtOH、1-PrOH、1-BtOH、 Acetone、MEK、DOX)

2. スケルトン粒子の光学特性発現に関わる 因子の解明

粒子の光学特性は、紫外可視光(UV-vis) 分光光度計を用いて求めた。

1 で示したように、粒子径、フレーム厚、 などスケルトン構造を制御した粒子の合成 が可能となった。得られた粒子をウレタンア クリル樹脂前駆体溶液に分散し、ガラス基板 上にコーティング後、硬化反応させた粒子複 合薄膜の光学特性を評価した。可視光波長領 域に見られる薄膜の透過性は、粒子の分散状 態を反映し、高い透過性を示した。スケルト ン粒子薄膜は、同粒子径程度の中実シリカ粒 子を同濃度添加した薄膜と比較して、可視光 波長域の透過性、拡散性ともに高い値を示し た。

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計9件)

- ① <u>Chika Takai</u>, Synthesis nanostructured particles and control of their dispersibility, Journal of the Society of Powder Technology, Japan, 査読有, 2014, accepted
- (2)Chika Takai, Takahiro Ishino, Takashi Shirai, Masavoshi Fuii. Rapid synthesis of hollow silica nanoparticles by inorganic template method, Annual Report of the Advanced Ceramics Research Center Nagoya Institute of Technology, 査読有, 2014, accepted
- 3 Chika Takai, Takahiro Ishino, Masayoshi Fuji, Takashi Shirai, Rapid and high yield synthesis of hollow silica nanoparticles using a NH₄F catalyst, Colloids and Surfaces A: Engineering Physicochemical and Aspects, 査読有, Volume 446, 5 April Pages 46-49, 2014, http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurf a. 2014. 01. 040
- ④ <u>Chika Takai</u>, Aya Tamura, Masayoshi Fuji, Synthesis of a silver nanoparticle network induced by a micro-phase separation, Advanced Powder Technology, 査読有, Volume 25, Issue 2, March 2014, Pages 621-624, http://dx.doi.org/10.1016/j.apt.201 3.10.002
- <u>Chika Takai</u>, Fumikazu Kawajiri, Masayoshi Fuji, Synthesis of SnO₂/SiO₂ composite nanoparticles using interaction between chelated precursor and silanol, Journal of the Society of Powder Technology, Japan, 査読有, 50(5): 322-331, 2013, DOI 無 し
- ⑥ <u>Chika Takai</u>, Masayoshi Fuji, Chisato Takahashi, Takashi Shirai, Tatsuya Tomioka, Mitsuo Utsuno, Synthesis of Spherical Calcite Hollow Particles and their Excellent Morphological Stability, Journal of the Society of Powder Technology, Japan, 査読有, 50(9): 618-624, 2013, DOI 無し
- ⑦ R V Rivera-Virtudazo, M Fuji, <u>C. Takai</u> and T Shirai, Fabrication of unique hollow silicate nanoparticles with hierarchically micro/mesoporous shell structure by a simple double template approach, Nanotechnology, 査 読 有, 23(48):485608, doi: 10.1088/0957-4484/23/48/485608
- (8) <u>Chika Takai</u>, Masayoshi Fuji, Kyoichi

Fujimoto, Thermal insulation film achieved by hollow silica nanoparticles, Journal of the Society of Powder Technology, Japan, 査読有, 49, pp. 260-266, 2012

(9) Chika Takai, Hideo Watanabe, Takuya Asai, Masayoshi Fuji, Determine apparent shell density for evaluation hollow silica nanoparticle, of Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 査読有, 404 (2012) 101-105, http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurf a. 2012. 04. 019

〔学会発表〕(計17件)

- ミクロ相分離を用いた銀ナノ粒子の三次元網目状微細配向形成、矢野晃啓, 高井千加,白井孝,藤正督、粉体工 学会2013年度春期研究発表会、5月21日、東京
- ② ポリアクリル酸をテンプレートとした ナノシリカ中空粒子の合成、今別府 寛, <u>高井 千加</u>,白井 孝,藤 正督、粉体工 学会 2013 年度春期研究発表会、5月 21 日、東京
- ③ 炭酸カルシウム/シリカコアシェル粒子の短時間合成、石野 尊拡、<u>高井 千加</u>、 藤 正督、白井 孝、粉体工学会第48

 回技術討論会、6月13日、京都
- ④ シリカ表面水酸基を利用した酸化スズ-シリカ複合ナノ粒子の合成、<u>高井千加</u>, 河尻 史和,藤 正督、粉体工学会第 48 回技術討論会、6月13日、京都
- ⑤ ミクロ相分離を用いたナノ粒子三次元 網目構造の新規作製法、矢野晃啓,田村 彩,<u>高井千加</u>,藤 正督,白井 孝、粉 体工学会第48回技術討論会、6月13日、 京都
- (6) Improved transparent thermal insulation using hollow silica nanoparticles, <u>C. Takai</u>, M. Fuji, T. Shirai, 10th Pacific Rim Conference on Ceramic and Glass Technology, June 6, USA
- ⑦ アセチルセルロースの相分離を利用した銀ナノ粒子網目構造の形成、高井 千加,田村彩,藤正督,白井孝、粉体工学会,第49回夏期シンポジウム、7月19日、山梨
- ⑧ ナノテクを用いた微粒子設計と環境材料への応用、<u>高井千加</u>、平成25年度第1回微粒子ナノテクロジー分科会回微粒子ナノテクロジー分科会、8月1日、愛知(招待講演)
- ・ 無機テンプレート法によるハイブリッドシリカ中空粒子の合成、<u>高井千加</u>、樽谷圭栄、藤正督、白井孝、粉体に関する討論会、9月12日、島根
- ⑩ ミクロ相分離を用いたナノ粒子三次元

網目構造の形成、矢野晃啓,田村 彩, <u>高井千加</u>,藤 正督,白井 孝、粉体工 学会平成25年度中部談話会、9月25日、 静岡

- ① ポリアクリル酸をテンプレートとして 用いた中空ナノシリカ粒子の合成、今別 府 寛,<u>高井 千加</u>,白井 孝,藤 正督、 粉体工学会平成 25 年度中部談話会、9 月 25 日、静岡
- ① ナノ孔をもつ粒子の合成と分散技術を 紹介します、<u>高井千加</u>、藤 正督、APPIE 産学官連携フェア 2013 シーズとニーズ のマッチングー粉の技術ー、10月10日、 大阪
- ③ ポリアクリル酸/アンモニア水溶液をテンプレートとした中空シリカナノ粒子の合成、今別府 寛、高井千加、白井 孝、藤 正督、平成 25 年度日本セラミックス協会東海支部学術研究発表会、12 月 7日、愛知
- (④ 炭酸カルシウムをテンプレートに用いたハイブリットシリカ中空粒子の合成、谷 将成、<u>高井千加</u>、藤 正督、白井 孝、平成 25 年度日本セラミックス協会東海支部学術研究発表会、12 月 7 日、愛知
- (1) 超音波照射による水中シリカナノ粒子の分散挙動一周波数と凝集径一、佐藤絵美子、<u>高井千加</u>、藤 正督、白井 孝、平成 25 年度日本セラミックス協会東海支部学術研究発表会、12月7日、愛知
- (b) ナノシリカ中空粒子を内包する透明断熱フィルムの作製、<u>高井千加</u>、第23回日本 MRS 年次大会、12月9日、神奈川
- ① ミクロ相分離を用いたナノ粒子三次元 配列構造制御、矢野晃啓、田村彩、<u>高井</u> 千加、白井孝、藤正督、第52回セラミ ックス基礎科学討論会、1月10日、愛知

〔図書〕(計1件)

①藤 正督、高井千加、Si02 ナノ中空粒子の 断熱フィルムへの応用、セラミックデータブ ック、82-84,2013

〔産業財産権〕 〇出願状況(計4件)

名称:表面改質されたシリカ殻からなる中空 粒子及びその製造方法 発明者:藤 正督、矢野 晃啓、白井 孝、高 井 千加 権利者:名古屋工業大学 種類:特許 番号:特願 2012-11328 出願年月日:2012 年 5 月 17 日 国内外の別:国内

名称:シリカナノ中空粒子の製造方法 発明者:藤 正督、石野尊拡、白井 孝、高井 千加 権利者:名古屋工業大学 種類:特許 番号:特願 2012-112256 出願年月日:2012 年 5 月 16 日 国内外の別:国内

名称:粗大粒子添加によるナノ粒子スラリー の分散処理方法 発明者:藤 正督、佐藤絵美子、白井 孝、高 井 千加 権利者:名古屋工業大学 種類:特許 番号:特願 2013-248960 出願年月日:2013年12月2日 国内外の別:国内

名称:高分子電解質をテンプレートとした中 空シリカナノ粒子の製造方法 発明者:藤 正督、今別府 寛、白井 孝、高 井 千加 権利者:名古屋工業大学 種類:特許 番号:特願 2014-043371 出願年月日:2014年3月6日 国内外の別:国内

○取得状況(計0件)

名称: 発明者: 権利者: 種類: 番号: 取得年月日: 国内外の別:

6.研究組織
(1)研究代表者
高井千加 (TAKAI, Chika)
名古屋工業大学先進セラミックス研究セン
ター・産学連携研究員
研究者番号: 30599056

(2)研究分担者

()

研究者番号:

(3)連携研究者
 藤 正督(FUJI, Masayoshi)
 名古屋工業大学工学研究科・教授
 研究者番号: 50238523